



MSP-12S

マグネトロンスパッタ

大面積マグネトロンスパッタ装置

- 12インチウェハに対応する大面積回転試料ステージを搭載。
- 任意箇所のみを可動式φ50mmターゲットで低ランニングコスト・コーティング。
- 印加電圧500V以下でイオンダメージを軽減するマグネトロン方式を採用。
- 100ℓRPを採用し、排気時間・ガスコントロール性を向上。
- ウェハの出し入れは楽々の前方引き出し方式を採用。



株式会社 真空デバイス

〒311-4155 茨城県水戸市飯島町 1285-5

Tel: 029-212-7600 Fax: 029-212-7601

E-mail: device@shinkuu.co.jp

特 徴 ・ 仕 様

特 徴

- ★ MSP-12S は SEM 観察用イオンスパッタ成膜装置です。
- ★ 小面積ターゲットを使用。マグネトロン電極は、当社製 MSP-1S 形サイズでランニングコストを気にする必要がなくなりました。
- ★ 試料台の回転機構とターゲットのスライド機構を併用して特定箇所のみを成膜。
- ★ 低電圧でコーティングすることにより、デリケートなサンプルに用いても試料損傷がほとんどありません。
- ★ AUTO コーティングモードを装備。脱ガス・雰囲気ガス導入・コーティングまでを全自動で行います。
- ★ 前方引き出し式試料ステージで 12 インチウェハの取出しが楽になりました。
- ★ 排気系は RP100ℓ/min を採用。クリーンルーム用にスクロールポンプ（オプション）への変更も可能です。
- ★ 空気雰囲気において成膜純度を高める為にガス流量を制限するバイパス機能搭載。

仕 様

ターゲット	直径 50mm マグネトロン型
成膜対象金属	Pt, Au, Ag, Au-Pd, Pt-Pd
試料ステージ	直径 308mm
ターゲットー試料間隔	30mm
搭載可能試料サイズ	φ 300mm、h 15mm 以下
チャンバーサイズ	内径 330mm x 深さ 90mm
イオン化電圧／電流	DC 0～500V／0～50mA 電流計読み取り
タイマー	OMRON 社製電子タイマー
排気系	RP100ℓ/min
真空度測定	ピラニ真空計
雰囲気ガス導入	アルゴンガス必須
安全対策	サーキットプロテクタ、及び系統別フューズ付
装置サイズ	W450mm×D520mm×H420mm 重量 56kg
電源	単相 AC 100 V, 15A アース線付 3 芯プラグ使用

本カタログ記載内容は、改良に伴い予告なしに変更する場合があります。ご了承ください。